集束イオンビーム付走査型電子顕微鏡（FIB）

メーカー	日本電子株式会社
型式	JIB-4601F
概要	走査電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)は電子線を試料に当てて表面を観察する装置で、様々な分野で幅広く利用されています。 本装置はショットキー形SEM とHigh Power FIB カラムを搭載した複合ビーム加工観察装置です。FIBにより局所的に断面加工した後、SEMで断面の観察・分析が行えます。また、FIBによる微細加工や一定間隔で断面加工/観察・分析を自動で行う三次元構造解析も可能です。ショットキー形のSEMにより微小な構造の観察、分析、さらに加工部位の位置決めが容易になります。 各種オプションにより、元素分析（EDS）や結晶方位（EBSD）測定も可能です。
仕様	対物レンズ：アウトレンズ型対物レンズ 倍率：×100～×300,000 二次電子像分解能：1.2 nm （30 kV、 WD4mm時） 3.0 nm （1 kV、WD2mm時） 加速電圧：0.2～30kV 照射電流：数pA ～ 200nA（ 15 kV） 検出器：二次電子検出器、反射電子検出器
オプション	EDS(Oxford)、EBSD（Oxford） ※非導電性試料へ導電性を付与するためのコーティングは、オペレーターが作業を行います（追加利用料なし）
利用条件	試料サイズ：最大φ32mm×高さ20mmまで （それ以上のサイズはご相談ください） 試料の状態：導電性試料 （コーティング可能であれば非導電性でも可） 含水試料は不可
設置場所	地域産学連携研究センター　装置室A
利用料	7,370円/時間（税込）
連絡先	予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。 044-934-7250（内線7250） cii●mics.meiji.ac.jp （●の部分を@に置き換えてお送りください）